

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成 27 年 11 月 5 日 (2015.11.5)

【公表番号】特表 2015-517020 (P2015-517020A)

【公表日】平成 27 年 6 月 18 日 (2015.6.18)

【年通号数】公開・登録公報 2015-039

【出願番号】特願 2014-555733 (P2014-555733)

【国際特許分類】

C 2 3 C 14/32 (2006.01)

C 2 3 C 14/48 (2006.01)

H 0 1 J 37/317 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 14/32 F

C 2 3 C 14/48 A

H 0 1 J 37/317 E

【手続補正書】

【提出日】平成 27 年 9 月 9 日 (2015.9.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

層を形成する方法であって、前記方法は、

その上への堆積に適合化された少なくとも 1 つの表面を有する基板を供給することと、  
基板の表面に向かって粒子ビームを送ることとを含み、前記粒子ビームは、適度に荷電したイオン (M C I) を含み、実質的にすべての前記 M C I は、 $\pm 2 \sim \pm 6$  の電荷と約 200 e V 以下の運動エネルギーとを個別に有し、

前記 M C I は、約 30 を超えて基板の表面内に侵入せず、基板上に層を形成する、方法。

【請求項 2】

実質的にすべての前記 M C I は、約 5 e V と 200 e V との間の運動エネルギーを有する、  
請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

実質的にすべての前記 M C I は、 $\pm 3 \sim \pm 6$  の電荷を有する、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

前記粒子ビームの供給源は、多重荷電イオンを生成するように構成される、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 5】

前記粒子ビームは、少なくとも加速減速ビーム輸送技術を用いて表面に向けて送られる、  
請求項 1 に記載の方法。